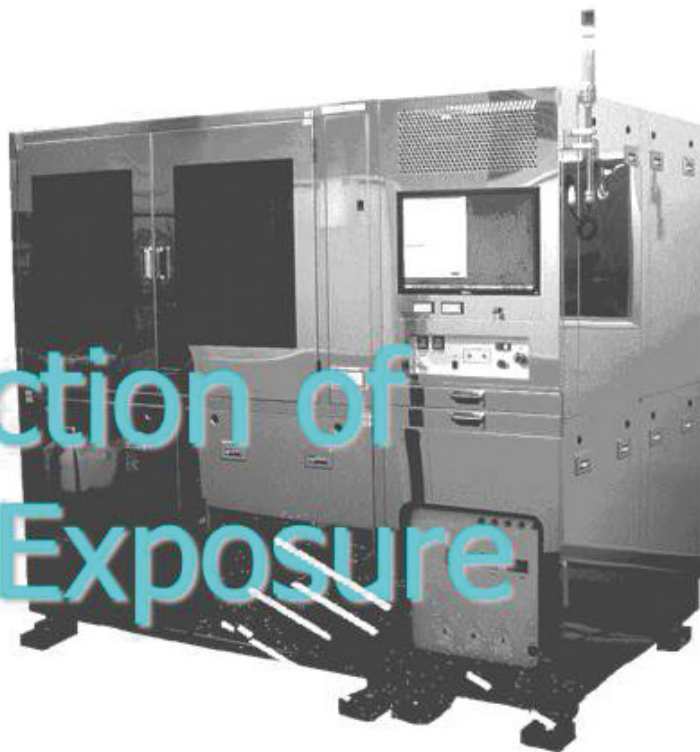


露光工程の納期短縮とコスト削減

Introduction of Maskless Exposure



Point of Array Maskless Exposure Method

製品・技術の名称 マスクレス露光装置

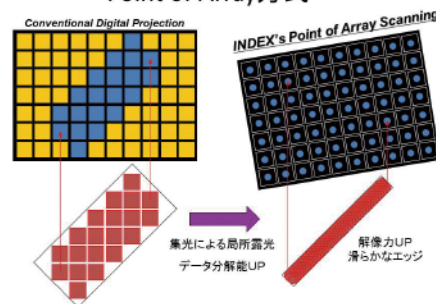
概要

半導体製造工程・マイクロセンサー（加速度センサー、圧力センサー、温度センサー、ガスセンサー）製造工程・プリント基板製造工程における露光技術は、フォトマスクを使用して、それを基板に転写する方式が主流です。

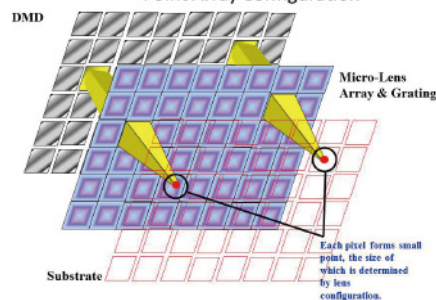
一方、本マスクレス露光装置は、DMD（デジタル・マイクロミラー・デバイス）を用いた独自のポイントオブアレイ方式で、CADデータから直接露光することができます。

そのために高価なマスクが不要となる上に、マスクデータの外部流出防止・描画パターン設計から描画までの時間短縮・描画パターンの設計変更が容易・各基板の歪みに合わせた露光パターンの補正等が可能となります。

Point of Array方式



Point Array Configuration



ここがポイント!

フォトマスクを使用しない露光方式では、世界最高レベル（1ミクロン以下）の露光精度を実現。試作開発が容易になり、時間・コストの削減に貢献。

参考価格

70,000,000 円 ※表示価格は税抜きです。

企業PROFILE

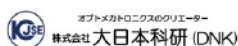
株式会社大日本科研

代表取締役：岡本 光三

京都府向日市寺戸町久々相 1 番地

Tel : 075-931-9066 / Fax : 075-931-9058

<http://www.kakenjse.co.jp>



企業からの一言 / PRポイント

新規な露光技術を用いて製品開発時の開発コスト削減と開発スピード向上に貢献し、顧客の製造プロセス改革に寄与します。販売面では直接販売はもとより、代理店網も利用してマスクレス露光装置を販売促進していきます。